

Datum:	März 2009
Anlage:	OM TMS_100.jpg.
Kennziffer:	PR-0007-FKAP-290109-TMS

Neue Komplettlösung für die großflächige 3D-Charakterisierung von Werkstücken

Eine Komplettlösung für den Einsatz von Topographie Messsystemen auf der Basis der scannenden Weißlicht –Interferometrie wurde kürzlich von Polytec vorgestellt. Das System beinhaltet

- ein Scannendes Weißlichtinterferometer,
- ein Schutzgehäuse mit leichtem Überdruck gegen Staubeindringung,
- einen aktiv geregelten Vibrationsdämpfertisch zur Dämpfung von Umgebungsschwingungen,
- eine Werkstück-Positioniereinheit zur automatischen Vermessungen von mehreren Proben,
- sowie einen Touch-Screen Monitor

Damit steht dem Anwender ein robustes und leicht zu bedienendes System zur Verfügung. Entsprechend der Applikation kann z.B. ein großflächig messendes Weißlichtinterferometer zur Vermessung von Ebenheiten, Parallelitäten, Höhen oder Oberflächenparameter mit einem z-Scanbereich bis 70mm gewählt werden. Mit dem TMS-100 Metro.Lab von Polytec steht ein Interferometer mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis zur Verfügung. Die schnelle und nanometergenaue Erfassung von Oberflächen bis zu 38 x 28 mm² liefert die 3D-Topographie auch von größeren Werkstücken. Zusammen mit dem automatischen Werkstückpositionierer ist das System ideal für die Stichprobenkontrolle in der Qualitätssicherung und ergänzt die In-line Lösungen von Polytec.

Mehr Infos und Live-Vorführung des Gerätes auf der Hannover Messe 2009: IVAM Messestand - in Halle 6 oder unter: www.polytec.de.

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel. 07243-604-236

Presse-Information



Datum: März 2009

Anlage: OM TMS_100 jpg.

Kennziffer: PR-0007-FKAP-290109-TMS



Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel. 07243-604-236

PR-0007-FKAP-290109-TMS.DOC